DIALOG(R)File 345:Inpadoc/Fam.& Legal Stat

(c) 2003 EPO. All rts. reserv.

8031565

Basic Patent (No, Kind, Date): JP 63006540 A2 880112 <No. of Patents: 001>

(English)

IPC: *G03B-027/54; G02B-017/00; G03F-007/20; H01L-021/30

Derwent WPI Acc No: G 88-047501 Language of Document: Japanese

Patent Family:

Patent No Kind Date Applic No Kind Date

JP 63006540 A2 880112 JP 86150891 A 860627 (BASIC)

Priority Data (No,Kind,Date): JP 86150891 A 860627

5°P 20674 3

EUROPEAN PATENT OFFICE

Patent Abstracts of Japan

PUBLICATION NUMBER

63006540

PUBLICATION DATE

12-01-88

APPLICATION DATE

27-06-86

APPLICATION NUMBER

61150891

APPLICANT: KOMATSULTD;

INVENTOR: KOWAKA MASAHIKO;

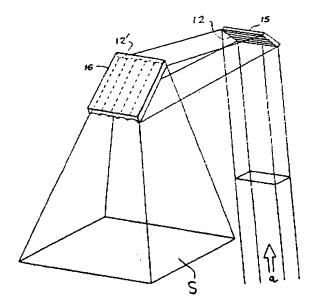
INT.CL.

: G03B 27/54 G02B 17/00 G03F 7/20

H01L 21/30

TITLE

: INTEGRATOR



ABSTRACT: PURPOSE: To equalize the intensity distribution of an incident beam by placing a first mirror having plural curved surfaces, and a second mirror having plural curved surfaces, which is opposed to the first mirror, so that those cured surfaces are orthogonal to each other.

> CONSTITUTION: Curved surfaces 12, 12' are formed in parallel in the first mirror 15 and the second mirror 16, respectively. Also, a first mirror 15 and a second mirror 16 are placed by aligning their optical axes by allowing them to be opposed to each other, and allowing them to be orthogonal to each other. Moreover, an inclination of each of the first and the second mirrors 15, 16 is adjusted, and a beam (a) is made incident from the direction as indicated with an arrow. In such a case, the first mirror 15 and the second mirror 16 expand and reflect uniformly a light beam in the horizontal direction of the beam (a), and a light beam in the vertical direction, respectively. Its radiated light beam is reflected like a square S, therefore, each of the first and the second mirror 15, 16 functions as an integrator and a reflecting mirror. Accordingly, since the first and the second mirrors are placed so that their curved surfaces become vertical to each other, an intensity distribution of an incident beam becomes uniform, and the beam can be reflected in a desired direction.

COPYRIGHT: (C)1988, JPO& Japio

①特許出願公開

⑩ 公 開 特 許 公 報 (A) 昭63-6540

@Int_Cl.⁴	識別記号	庁内整理番号		❸公開	昭和63年(19	88)1月12日
G 03 B 27/54 G 02 B 17/00		Z-8106-2H 8106-2H				
G 03 F 7/20 H 01 L 21/30	3 1 1	7124-2H 7376-5F	審査請求	未請求	発明の数 1	(全4頁)

49発明の名称

インテグレータ

②特 願 昭61-150891

20出 頭 昭61(1986)6月27日

神奈川県横浜市戸塚区尾月14-18 康 燇 野 末 切発 明 者 神奈川県平塚市万田18 康 夫 倉 板 @発 明 者 聪 神奈川県平塚市万田18 藤 仙 79発 明 者 伊 神奈川県平塚市万田18 若 林 理 明 者 砂発 神奈川県中郡二宮町中里2-3-30 明 者 本 准 79発 藤 雅 奆 神奈川県平塚市万田18 若 勿発 明 者 小 東京都港区赤坂2丁目3番6号 株式会社小松製作所 願 の出 人 高久 20代 理 人 弁理士 木村

1. 発明の名称

インテグレータ

2. 特許請求の範囲

(1)表面に複数の第1の曲面が平行に形成された第1のミラーと、

該第1のミラーと対向して配設され、表面に的記第1の曲面と方向が互いに直角になるように複数の第2の曲面が平行に形成された第2のミラーと

を具えたことを特徴とするインテグレータ。

- (2) 第1の曲面および第2の曲面は凹状に形成されることを特徴とする特許請求の範囲第(1)項記載のインテグレータ。
- (3)第1の曲面および第2の曲面は凸状に形成されることを特徴とする特許請求の範囲第(1)) 項記載のインテグレータ。
 - (4) 第1の曲面は凹状に形成され第2の曲面

は凸状に形成されることを特徴とする特許請求の 範囲第(1) 項記載のインテグレータ。

(5) 第 1 の曲面は凸状に形成され第 2 の曲面は凹状に形成されることを特徴とする特許請求の 範囲第 (1) 項記載のインテグレータ。

3. 発明の詳細な説明

〔産業上の利用分野〕

本発明は、均一な強度分布のレーザ光を発生させるインテグレータに関する。

(従来の技術)

従来、このようなインテグレータには、凹又は 凸レンズからなるマイクロレンズを多数並べて接 着剤で接合させて構成するフライアイインテグレ ータといわれるものがある。このフライアイイン テグレータは、強度分布のある光を上記マイクロ レンズによって均一な強度分布の光にする。

また他のインテグレータとして特 類 昭 6 0 - 2 2 0 1 4 2 号に記載したものがある。このインテグレータでは、第 4 図に示すように、透明体 1

の一方の面には複数の曲面2を水平方向に、また上記面に相対する面には曲面2と同様の複数の曲面3を垂直方向にそれぞれ平行に形成して構成される。

(発明が解決しようとする問題点)

b

11の表面に所望の曲率半径の凹状の溝12を一方向に平行に形成するとともに上記表面に、例えば金属、金属+誘電体または誘電体等の高反射コーティングを施して形成される。なお上記溝12の形状は、所望の曲率半径の凸状に形成してもさしつかえない。

 射したピームの強度分布を均一にし、所望の方向 に反射することのできるインテグレータを提供す ることを目的とする。

(問題点を解決するための手段および作用)

本発明は、表面に複数の第1の曲面が平行に形成された第1のミラーと、該第1のミラーと対のして配設され、表面に前記第1の曲面と方向が近に直角になるように複数の第2の曲面が平行に形成された第2のミラーとを具え、第1およびのミラーに入射した強度分布の不均一ので望の方向に反射することができる。

(実施例)

本発明のインテグレータの実施例を第1図乃至 第3図の図面にもとづき詳細に説明する。

本発明のインテグレータは、第1のミラーと第2のミラーによって構成されており、第1のミラーと第2のミラーは、第1図に示すような同一の構成になっている。すなわち第1図において、第1および第2のミラーは、石英等からなる基板

なおこの第1、第2のミラーの溝の組み合せは、 凸+凸、凸+凹または凹+凹のいずれでも良く、 酒の方向も互いに垂直になるように設定されてい れば、いずれが水平方向でも、垂直方向でもかま わない。

 2 4 上での照明エリアは、上記インテグレータおよび集光ミラーにより強度分布が均一であり干渉 じまも生じない。このレチクル 2 4 を照射する光 線によりレチクル 2 4 上に形成されたパターンは、 縮小投影レンズ群 2 5 を介してウェハ 2 5 上に投 影される。

4. 図面の簡単な説明

ß

第1図は本発明のインテグレータを構成するミラーの一実施例を示す図、第2図はインテグレータの配置図、第3図は本発明のインテグレータを用いた縮小投影露光装置の一実施例を示す図、第4図は従来のインテグレータを示す図である。

1 1 … 基板、1 2 … 溝、1 5 … 第 1 のミラー、1 6 … 第 2 のミラー、2 0 … エキシマレーザ、2 1 … 集光ミラー、2 3 … 防塵板、2 4 … レチクル、2 5 … 縮 小投影レンズ群、2 6 … ウェハ。

出願人代理人 木 村 高 久



板に遠紫外光の透過率の高い石英、CaF2 またはMgF2 等の材質で形成される薄いペリクル板を用いてレチクルへのほこりの付着を防止している。

なお、本発明の実施例では、第1、第2のミラーの基板は平板に形成された場合について説はなりまたが、上記実施例に限らず、光の拡がりを少なくするため第1回に示した基板を曲面で形成なせることもできるので、コンデンサレンズの機能をも兼ねることが可能となる。

(発明の効果)

以上説明したように本発明は、 変面に複数の曲面が平行に形成された第1のミラーと第2のミラーを見え、 該第1および第2のミラーの曲面の方向が互いに直角になるように前記第1のミラーと前記第2のミラーを対向配置させるので、入射したビームの強度分布を均一にし、所望の方向に反射することができる。

